



森美协尔国际有限公司
SEMISHARE INTERNATIONAL LIMITED

地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05至15室
Add: Rooms 05-15, 13A/F., South Tower, World Finance Centre, Harbour
City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Tel: (852) 2206 0092
Fax: (852) 3003 0133
Email: sales@semishare.com

国内代理商：

深圳市森美协尔科技有限公司
SEMISHARE(SHENZHEN)TECHNOLOGY CO.,LTD.

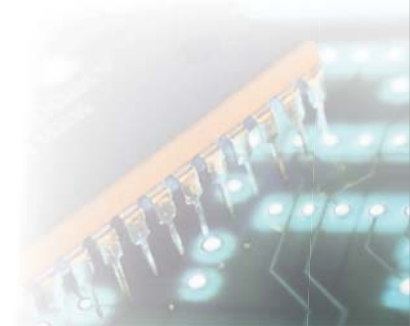
地址：深圳市宝安区西乡街道恒丰工业城C1栋301
Add: The 3th floor of C1 building, Hengfeng industrial zone of Xixiang,
Bao'an district, Shenzhen, China
Tel: +86-755-2690 6952
Fax: +86-755-8529 9649
Email: sales@semishare.com

深圳市鑫志尚电子有限公司
SEMISHARE(SHENZHEN)ELECTRONIC CO.,LTD

地址：深圳宝安区福永怀德翠岗工业一区4栋
Add: 4th Building, The first Industrial Zone, HuaideCuigang, Fuyong
Town, Bao'an District, Shenzhen
Tel: +86-755-2690 6952
Fax: +86-755-2733 2216
Email: sales@semishare.com



产品目录



公司简介

COMPANY PROFILE



森美协尔国际有限公司(SEMISHARE)致力半导体技术的共享事业,专注于促进中国半导体行业的快速成长,目标成为半导体行业领先的total solution供应商。目前设有半导体仪器营销事业部和半导体设备制造工厂。

SEMISHARE半导体仪器营销事业部代理的设备包括半导体检测设备:SEMISHARE品牌探针台(prober)和激光修复机(laser repair),I-V/C-V参数测试仪,网络分析仪,激光系统,金相显微镜,EMMI微光显微镜,X射线,C-SAM超声波探测,电子显微镜。晶圆工艺设备:晶圆键合,去胶,沉积,等离子刻蚀,扩散,氧化炉,匀胶机,光刻机,磁控溅射机台,电子束蒸渡机。

SEMISHARE 半导体仪器营销事业部立足中国深圳,香港,北京,上海,西安等城市为全中国半导体行业提供全球最先进的半导体检测和工艺设备营销与技术集成服务,助力先进技术的研发。

SEMISHARE 半导体设备制造工厂总资产达5000万余元,厂房面积约5000平方米,现有员工100余人,其中专业技术人员70余人,公司拥有先进的生产工艺及品控检测,主要设备有:CNC加工中心、CNC高光机、飞秒激光镭射机、精密车床、磨床、铣订、线割机、火花机、半导体参数测试仪、耐磨测试仪、人工测试仪真空检漏仪、激光干涉仪等。2009年,我们开始研发制造SEMISHARE品牌探针台和激光修复设备,获得20多项国家专利和软件授权,ISO9001-2015国际质量管理体系认证,深圳市高新技术企业,国家高新技术企业等。

SEMISHARE拥有热诚,专业的员工和遍及中国的营销及服务网络,快速响应客户需求,提供客户化的产品和端到端的服务,助力客户的成功。

目前,SEMISHARE的产品和解决方案已经应用于中国100多家客户,服务中国半导体研发机构前50强中的40多家。

企业资质

COMPANY CERTIFICATION



公司文化

COMPANY CULTURE

诚信

诚信是SEMISHARE的成长基石。

SEMISHARE对外交往、宣传以及发展公司业绩始终如一的坚持诚信务实;坚持企业稳健经营的发展方向、不为暂时的利益弄虚作假、舍弃公司的诚信根本。

分享

分享是SEMISHARE的精神追求和存在的意义。
鼓励员工参与公司活动,在事业,薪酬,感情上与公司共同成长;
与供应商和客户创建长期合作关系,共同承担责任和分享成功;
积极地参与社会公益活动,回报社会。

学习

学习是SEMISHARE始终充满活力和保持竞争力的源泉。
SEMISHARE需要不断地自我批评、及时信息反馈和充分交流而力求进步;
更好的学习调节有效管理和防止官僚化之间的平衡点;
更加彻底地分析与客户的联系;
更系统地从过去和当前的项目与产品中学习;
更深刻的建立员工间的沟通、信任和共享。

COMPANY CERTIFICATE



COMPANY PATENT



经营理念

坚持高度职业道德

对客户我们说真话并且努力实现对客户的承诺。

对供应商我们以客观、公正的态度进行挑选及合作。

在公司内部，我们绝不容许贪污；不容许在公司内有派系产生；也不容许公司政治的形成。

放眼世界市场, 国际化经营

我们的市场定位是在全球市场中建立竞争力。

注意长期策略, 追求永续经营

我们注重企业永续经营, 做长期战略规划, 并认真的执行。

与供应商和客户分享我们的成功

我们视供应商和客户的竞争力为SEMISHARE的竞争力, 供应商和客户成功为SEMISHARE的成功, 我们努力塑造良性循环的合作模式。

品质是我们工作与服务的原则

在SEMISHARE, 品质是每一个员工的责任, 我们本着追求卓越、精益求精的态度, 认真的把每一件事、每一件任务做到最好, 并且不断改进, 力求更上一层楼。

鼓励在各方面的学习, 确保高度企业活力

SEMISHARE需要不断地学习进步, 常保公司充满蓬勃朝气与活力, 随时秉持积极进取、高效率的处事态度, 来因应瞬息万变的产业市场特性。

营造具挑战性、有乐趣的工作环境

我们要齐力塑造并维持一个具挑战性, 有乐趣的环境, 培养并吸引志同道合而且最优秀的人才。

建立开放型管理模式

我们要营造乐于沟通的环境, 以建立开放型管理模式。同事间互以诚信、坦率、合作相待。同事乐于接受意见, 也乐于改进自己。同时, 更将透过集思广益的方法接受各方看法, 而在做成决定后, 就团结一致、不分你我、集中力量朝共同目标戮力以赴。

努力回馈社会

我们深刻的认识SEMISHARE的成长也得力于社会及产业环境的配合, 我们须要不断地尽能力回馈社会, 做一个良好的企业公民。

SEMISHARE全体同事需要随时信守本公司的经营理念, 并落实于工作中。

市场及应用

● 集成电路方向

● 晶圆电性测试

● 芯片线路修改

● 失效分析

● 芯片反向拍照

● 平面显示方向

● LCD、OLED亮点、线路修复

● 面板探针测试

● 印刷线路版方向

● PCB印刷线路版电性测试

● 掩模版方向

● 掩模版缺陷修复

● 光伏太阳能方向

● 太阳能电池片划片、划线

● 电池片光电效率测试

● LED方向

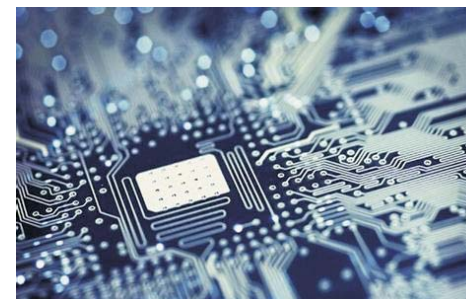
● EL测试

● 电性测试

● 触摸屏方向

● 触摸屏ITO短路激光修复

● 激光刻蚀



Model SM series

小型分析探针台



- ☑ 紧凑的结构
- ☑ 精巧的质量
- ☑ 实惠的价格
- ☑ 高等院校/研究所实验室使用
- ☑ 最大可用于6英寸以内样品测试
- ☑ 精密丝杠传动结构，线性移动
- ☑ 无回程差设计
- ☑ 50微米以上电极/PAD测试
- ☑ LD/LED/PD的光强/波长测试
- ☑ 材料/器件的IV/CV特性测试

Model SM series

规格

型号		SM-4	SM-6 mini	SM-6
外形		400mm长* 400mm宽* 550mm高	400mm长* 400mm宽* 550mm高	680mm长* 530mm宽* 550mm高
重量		约30公斤	约35公斤	约45公斤
电力需求		220VC,50~60Hz		
样品台	尺寸	4英寸, 可360度旋转	6英寸, 可360度旋转	6英寸, 可360度旋转
	X-Y行程	4*4英寸	4*4 英寸	6*6英寸
	移动精度	10um		
	样品固定方式	真空吸附		
	背电极测试功能	有, 样品台电学独立悬空		
针座平台		U型平台, 最多可放置6个小型针座		U型平台, 最多可放置8个小型针座
光学特性	显微镜行程	可360度旋转, Z轴: 50.8mm		
	放大倍数	16~100X （200X可选）		
	CCD像素	50W（模拟）/200W（数字）/500W（数字）		
点针规格	X-Y-Z行程	12mm-12mm-12mm		
	机械精度	10微米/2微米/0.7微米		
	漏电精度	10pA/100fA （配置屏蔽箱时）		
	接口形式	香蕉头/鳄鱼夹/同轴/参轴接口		
可选附件		加热台		光强/波长测试选件
		屏蔽箱		射频测试附件
		转接头		有源探头
		防震台		低电流/电容测试选件
		镀金卡盘		兼容积分球测试选件
		同轴/三轴卡盘		光纤夹具耦合测试选件
		样品台快速升降, 微调升降装置选件		PCB/封装夹具测试选件
		样品台旋转微调选件		特殊定制
应用方向		芯片及LD/LED/PD测试, PCB/封装器件测试, 射频测试等。		

Model SE series

晶圆测试探针台



- ✓ 紧凑的结构, 实惠的价格
- ✓ 兼容高倍率金相显微镜, 可微调移动
- ✓ 高等院校/研究所/公司实验室使用
- ✓ 最大可用于12英寸以内样品测试
- ✓ 精密丝杠传动结构, 线性移动
- ✓ 无回程差设计
- ✓ 1微米以上电极/PAD测试
- ✓ LD/LED/PD的光强/波长测试
- ✓ 材料/器件的IV/CV特性测试
- ✓ 器件的高频特性测试(最高至300GHz频率)

Model SE series

规格

型号		SE-4	SE-6	SE-8	SE-12
外形		580mm长* 620mm宽* 730mm高	600mm长* 700mm宽* 730mm高	660mm长* 660mm宽* 700mm高	1030mm长* 820mm宽* 730mm高
重量		约70公斤	约80公斤	约85公斤	约180公斤
电力需求		220VC,50~60Hz			
样品台	尺寸	4英寸, 可360度旋转	6英寸, 可360度旋转	8英寸, 可360度旋转	12英寸, 可360度旋转
	X-Y行程	4英寸*4英寸	6英寸*6英寸	8英寸*8英寸	12英寸*12英寸
	Z轴行程	6mm (快速切换)/6mm (微调)			
	移动精度	10um/1um			
	样品固定方式	真空吸附			
	背电极测试功能	有, 样品台电学独立悬空			
针座平台		U型平台, 最多可放置6个针座	U型平台, 最多可放置8个针座	U型平台, 最多可放置10个针座	U型平台, 最多可放置12个针座
光学特性	显微镜行程	X-Y轴行程2英寸*2英寸, Z轴: 50.8mm			
	显微镜移动精度	1um			
	切换镜头方式	显微镜快速倾仰30度			
	放大倍数	16~100X/20~4000X			
	镜头规格	目镜: 10X; 物镜: 5X,10X,20X,50X, 100X (选配)			
	CCD像素	50W (模拟)/200W (数字)/500W (数字)			
点针规格	X-Y-Z行程	12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm			
	机械精度	10微米/2微米/0.7微米/0.1微米			
	漏电精度	10pA/100fA (配置屏蔽箱时)			
	接口形式	香蕉头/鳄鱼夹/同轴/叁轴接口			
应用方向		芯片及LD/LED/PD测试, PCB/封装器件测试, 射频测试等。			
可选附件	显微镜倾仰装置 (倾仰30度)	高温样品台		光强/波长测试选件	
	显微镜气动升降装置	屏蔽箱		射频测试附件	
	激光微加工	转接头		有源探头	
	探针卡夹具	防震台		低电流/电容测试	
	显微镜暗场/DIC/Normarski 检测光强/波长测试接口部件	镀金卡盘		兼容积分球测试选件	
	液晶漏电分析套装	同轴叁轴卡盘		光纤夹具耦合测试选件	
	高压/大电流测试套件	样品台快速升降, 微调升降装置选件		PCB/封装夹具测试选件	
	加热台	样品台旋转微调选件		特殊定制	
特点	1. 显微镜龙门柱式设计, 可使显微镜在水平面内移动。				
	2. 显微镜可倾仰或气动升降, 便于更换物镜。				
	3. 可升级做射频, 高压大电流方面的测试和激光修复应用。				
	4. 精密驱动卡盘, 移动精度高。				

Model SH series

综合型分析探针台



- ✓ 稳定的结构, 针座平台可快速升降和微调, 适合针卡测试
- ✓ 兼容高倍率金相显微镜, 可微调移动
- ✓ 高等院校/研究所实验室使用
- ✓ 最大可用于12英寸以内样品测试
- ✓ 精密丝杠传动结构, 线性移动
- ✓ 大手柄驱动, 操作舒适, 无回程差设计
- ✓ 芯片内部线路/电极/PAD测试
- ✓ LD/LED/PD的光强/波长测试
- ✓ 材料/器件的IV/CV特性测试
- ✓ 器件的高频特性测试(最高至300GHz频率)

Model SH series

规格

型号	SH-6	SH-8	SH-12
外形	820mm长* 720mm宽* 890mm高	960mm长* 850mm宽* 900mm高	1300mm长* 920mm宽* 920mm高
重量	约170公斤	约230公斤	约300KG
电力需求	220VC,50~60Hz		
样品台	尺寸	6英寸, 可360度旋转	8英寸, 可360度旋转
	行程	X-Y行程6*6英寸	X-Y行程8*8英寸
	移动精度	1um	
	样品固定方式	真空吸附	
针座平台	规格	U型平台, 最多可放置6个针座	U型平台, 最多可放置10个针座
	行程&调节方式	平台可以快速升降, 行程 6mm, 并带自动锁定功能; 可以上下微调, 行程25mm, 升降精度1um	
光学特性	显微镜行程	X-Y轴行程2英寸*2英寸, Z轴: 50.8mm	
	显微镜移动精度	1um	
	切换镜头方式	显微镜快速倾仰30度	
	放大倍数	20~4000X	
	镜头规格	目镜: 10X; 物镜: 5X,10X,20X,50X, 100X (选配)	
点针规格	CCD像素	50W(模拟)/200W(数字)/500W(数字)	
	X-Y-Z行程	12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm	
	机械精度	10微米/2微米/0.7微米/0.1微米	
	漏电流精度	10pA/100fA (配置屏蔽箱时)	
应用方向	接口形式	香蕉头/鳄鱼夹/同轴/叁轴接口	
	应用方向	晶圆测试, 光电器件测试, PCB/封装器件测试, 射频测试, 高压/大电流测试等	
可选附件	卡盘快速拉出装置	加热台	光强/波长测试选件
	显微镜倾仰装置 (倾仰30度)	高低温样品台	射频测试附件
	显微镜气动升降装置	屏蔽箱	有源探头
	激光微加工	转接头	低电流/电容测试
	探针卡夹具	防震台	兼容积分球测试选件
	显微镜暗场/DIC/Normarski 检测光强/波长测试接口部件	镀金卡盘	光纤夹具耦合测试选件
	液晶热点探测套装	同轴叁轴卡盘	封装器件夹具
	高压/大电流测试套装	样品台快速升降, 微调升降装置选件	PCB/封装夹具测试选件
	带真空底座的活动Chuck	样品台旋转微调选件	特殊定制

Model SC series

高低温分析探针台



- ✓ 非真空环境下的低温测试, 可达-100°C
- ✓ 兼容高倍率金相显微镜, 可微调移动
- ✓ 高等院校/研究所/公司实验室使用
- ✓ 最大可用于12英寸以内样品测试
- ✓ 精密丝杠传动结构, 线性移动
- ✓ 大手柄驱动, 操作舒适, 无回程差设计
- ✓ 0.2微米以上芯片内部线路/电极/PAD测试
- ✓ LD/LED/PD的光强/波长测试
- ✓ 材料/器件的IV/CV特性测试
- ✓ 器件的高频特性测试(最高至300GHz频率)

Model SC series

规格

型号		SC-6	SC-8	SC-12
外形		860mm长* 850mm宽* 700mm高	880mm长* 860mm宽* 750mm高	1400mm长* 920mm宽* 920mm高
重量		约150公斤	约170公斤	约250KG
电力需求		220VC,50~60Hz		
样品台	尺寸	6英寸, 可360度旋转	8英寸, 可360度旋转	12英寸, 可360度旋转
	行程	X-Y行程6*6英寸	X-Y行程8*8英寸	X-Y行程12英寸*12英寸
	移动精度	1um		
	切换样品功能	样品台快速拉出		
	样品固定方式	真空吸附		
针座平台	电学运用	电学独立悬空, 可作为背电极使用		
	规 格	O型平台, 最多可放置8个针座 O型平台, 最多可放置10个针座 O型平台, 最多可放置12个针座		
	行程&调节方式	平台可以快速升降, 行程 6mm, 并带自动锁定功能; 可以上下微调, 行程25mm, 升降精度1um		
温控特性	温度范围	- 100~200℃	- 80~200℃	- 60~200℃
	温控精度	温度分辨率 : 0.01℃		
	加热电源	LVDC 低压直流		
	最低控温速率	±0.1℃ /小时		
	制冷方式	液氮制冷		
光学特性	显微镜行程	X-Y轴行程2英寸*2英寸, Z轴 : 50.8mm		
	切换镜头方式	显微镜气动升降		
	放大倍数	16~100X/20~4000X		
	镜头规格	目镜 : 10X ; 物镜 : 5X,10X,20X,50X , 100X (选配)		
点针规格	CCD像素	50W(模拟)/200W(数字)/500W(数字)		
	X-Y-Z行程	12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm		
	机械精度	10微米/2微米/0.7微米/0.1微米		
	漏电精度	10pA/100fA (配置屏蔽箱时)		
应用方向	接口形式	香蕉头/鳄鱼夹/同轴/叁轴/SMA/K接口		
	高低温环境下, LD/LED/PD测试, PCB/封装器件测试, 射频测试等			
可选附件	探针卡夹具		防震台	低电流/电容测试
	显微镜暗场/DIC/Normarski 检测光强/波长测试接口部件		镀金卡盘	光纤夹具耦合测试选件
	射频测试附件		同轴叁轴卡盘	封装器件夹具
	高压/大电流测试套装		光强/光谱/波长测试选件	PCB/封装夹具测试选件
	屏蔽箱		有源探头	特殊定制
	转接头		-	-

Model SCG series

高低温真空探针台



- ✓ 可进行真空环境下的高低温测试 (4.2K-450K)
- ✓ 防辐射屏设计, 样品温度均匀性和稳定性更好
- ✓ 兼容高倍率金相显微镜, 可微调移动
- ✓ 探针热沉设计
- ✓ 可升级自动流量控制
- ✓ 可升级加载磁场
- ✓ 支持光纤光谱特性测试
- ✓ 器件的高频特性(支持最高67GHz频率)
- ✓ LD/LED/PD的光强/波长测试
- ✓ 材料/器件的IV/CV特性测试

Model SCG series

规格

型号		SCG-O-2	SCG-O-4	SCG-C- 2	
外形		900mm长*900mm宽*530mm高	1100mm长*1100mm高*530mm高	1100mm长*1100mm宽*1030mm高	
重量		约170公斤	约190公斤	约290公斤	
电力需求		AC220V,50~60HZ			
样品台	尺寸	2英寸	4英寸	2英寸	
	样品固定方式	真空导热硅脂/弹簧压片			
	样品台移动	固定的样品台			
	真空度	10 ⁻¹ ~10 ⁻⁷ torr 最高真空			
光学特性	显微镜行程	2*2英寸	4*4英寸	2*2英寸	
	放大倍数	变焦：7:1分辨率4μm (放大倍数216X)或者选用金像显微镜（20X~1000X）			
	真空腔观察窗尺寸	2inch	4inch	2inch	
	CCD像素	50W（模拟）/200W（数字）/500W（数字）			
温控规格	制冷方式	液氮 / 液氦		制冷压缩机	
	控制方式	开循环手动/自动冷媒流量控制		闭循环自动控制	
	控温范围	77K~450K/4.2K~450K		4.2K~450K	
	控温分辨率	0.001K			
	温度稳定性	4.2K	± 0.2K	77K	± 0.1K
		373K	± 0.08K	473K	± 0.1K
		823K	± 0.2K(可选)	973K	± 1.0K(可选)
	常温到 8K冷却时间	90min		150min	
	8K到常温升温时间	90min		90min	
	常温开始的升温时间	100℃	150℃	200℃	
		30min	50min	80min	
	加热电源	LVDC 低压直流			
	传感器	硅二极管			
传感器数量	样品台，防辐射屏，探针臂各一个				
点针规格	功率	50W/100W/500W/1000W			
	探针数量	2个/4个/6个			
	探针调节	真空波纹管外部调节，手动控制			
	点针精度	10微米 /2 微米 /0.7 微米			
	点针行程	25mm-25mm -25mm			
	漏电流精度	10pA/100fA			
	接口形式	三轴/SMA/K/光纤接口			
可选附件	防震桌				
	多级压缩制冷机				
	机械泵 / 分子泵组 / 离子泵				
	射频部件				
	Chuck运动装置				
	电磁铁系统/超导磁铁系统				
	1Mpa正压系统升级				
	超高温升级选件				
应用方向	超高温真空升级选件				
	客户特殊定制				
	应用方向				
高低温真空环境下的芯片测试，材料测试，霍尔测试，电磁输运特性等					

Model SCG - AUTO series

半自动高低温真空探针台



- ✓ 可进行真空环境下的高低温测试 (4.2K-450K)
- ✓ 防辐射屏设计, 样品温度稳定性更好
- ✓ 兼容高倍率金相显微镜, 可微调移动
- ✓ 探针热沉设计
- ✓ 可升级自动流量控制
- ✓ 半自动批量测试
- ✓ 支持光纤光谱特性测试
- ✓ 器件的高频特性(支持最高67GHz频率)
- ✓ LD/LED/PD的光强/波长测试
- ✓ 材料/器件的IV/CV特性测试

Model SCG-AUTO series

规格

型号	SCG-Auto-0-2	SCG-Auto-0-4
外形	1500mm长*1200mm宽*800mm高	1900mm长*1400mm宽*900mm高
重量	约300公斤	约350公斤
电力需求	AC220V,50~60HZ	
样品台	尺寸	2英寸
	样品固定方式	真空导热硅脂/弹簧压片
	样品台移动	2*2英寸, 电动
	样品台移动	1um
	正压环境	5~10个大气压 最高真空
光学特性	真空度	10 ⁻⁶ ~10 ⁻⁷ torr
	显微镜行程	2*2英寸
	放大倍数	变焦: 7:1分辨率5μm (放大倍数216X) 或者选用金像显微镜 (20X~1000X)
	真空腔观察窗尺寸	2inch
	CCD像素	50W(模拟) /200W(数字) /500W(数字)
温控规格	制冷方式	液氮/液氨
	控制方式	开循环手动/自动冷媒流量控制
	控温范围	77K~450K/4.2K~450K
	控温分辨率	0.001K
	温度稳定性	4.2K ± 0.2K
		77K ± 0.1K
		373K ± 0.08K
	823K ± 0.2K (可选)	473K ± 0.1K
		973K ± 1.0K (可选)
	常温到 8K冷却时间	90min
	8K到常温升温时间	90min
	常温开始的升温时间	100 °C 150 °C 200 °C
		30min 50min 80min
点针规格	加热电源	LVDC 低压直流
	传感器	硅二极管
	传感器数量	样品台, 防辐射屏, 探针臂各一个
	功率	50W/100W/500W/1000W
	探针数量	2个/4个/6个
	探针调节	真空波纹管外部调节, 三轴机械手
	点针精度	10微米 /2 微米 /0.7 微米
	X- Y- Z行程	25mm-25mm-25mm
软件功能	漏电流精度	10pA/100fA
	接口形式	三轴/SMA/K/光纤接口
	晶圆Map编辑	测试仪器加载
		自动运动控制
		运动视觉补偿
		数据采集分析
应用方向	参数一体化显示	
	高低温真空环境下的晶圆测试, MEMS测试, 材料测试, 霍尔测试, 电磁运输特性等	
可选附件	防震桌	Chuck运动装置
	多级压缩制冷机	电磁铁系统/超导磁铁系统
	机械泵/分子泵组/离子泵	超高温升级选项
	射频部件	超高真空升级选项
	超高压力升级选项	客户特殊定制

Model FA series

失效分析探针台



- ☑ 失效分析实验室专用
- ☑ 可做LC液晶热点侦测
- ☑ 激光可选择性去除特定材料而不损伤下层
- ☑ 适用于IC/面板内部线路修改/去层
- ☑ 可升级用于12英寸以内样品测试
- ☑ 大手柄驱动，操作舒适，无回程差设计，定位准确
- ☑ 芯片内部线路/电极/PAD测试
- ☑ 射频特性器件失效分析
- ☑ 材料/器件的IV/CV特性测试及失效分析
- ☑ 激光最小可加工精度1*1um

Model FA series

规格

规格	FA-8	FA-8-SC
外形	960mm长 * 850mm宽 * 1500mm 高	880mm长 * 860mm宽 * 1550mm 高
重量	约 260公斤	约 280公斤
电力需求	220VAC, 50~60Hz	
样品台	尺寸	8英寸, 可 360 度旋转
	行程	X- Y行程 8*8 英寸
	移动精度	1um
	样品固定方式	真空吸附
	温控范围	-
	快速拉出	-
针座平台	特殊运用	电学独立悬空, 可作为背电极使用
	规格	U型平台, 最多可放置 10 个针座
光学特性	行程&调节方式	O型平台, 最多可放置 12 个针座
	显微镜行程	平台可以快速升降, 行程 6mm并带自动锁定功能
	放大倍数	X- Y轴行程 2英寸 * 2英寸, Z轴 : 50.8mm
	镜头切换时操作	X- Y轴行程 1英寸 * 1英寸, Z轴: 50.8mm
激光特性	波段	快速倾仰 / 气动升降
	功率	50W (模拟) / 200W (数字) / 500W (数字)
	微加工能力	50W (模拟) / 200W (数字) / 500W (数字)
	精度	50W (模拟) / 200W (数字) / 500W (数字)
点针规格	冷却方式	可选择风冷激光或水冷激光
	X- Y- Z行程	12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm
	机械精度	2微米/0.7 微米/0.1 微米
	漏电流精度	10pA/100fA (配置屏蔽箱时)
可选附件	接口形式	香蕉头/鳄鱼夹/同轴/叁轴接口
	卡盘快速拉出装置	卡盘快速拉出装置
	液晶热点侦测套装	液晶热点侦测套装
	高压 / 大电流测试套装	高压 / 大电流测试套装
	加热台	-
	屏蔽箱	屏蔽箱
	转接头	转接头
	防震台	防震台
	镀金卡盘	镀金卡盘
	同轴叁轴卡盘	同轴叁轴卡盘
	样品台快速升降, 微调升降装置选件	-
	光强 / 波长测试选件	光强 / 波长测试选件
	射频测试附件	射频测试附件
	有源探头	有源探头
	低电流 / 电容测试	低电流 / 电容测试
	光纤夹具耦合测试选件	光纤夹具耦合测试选件
	封装器件夹具	封装器件夹具
	PCB/ 封装夹具测试选件	PCB/ 封装夹具测试选件
	特殊定制	特殊定制
应用方向	常温和高低温环境下的芯片失效分析	

Model SHCV series

半自动分析探针台



- ☑ Si/SiC/GaN 等晶圆测试
- ☑ 大功率晶圆测试
- ☑ (-80~200℃) 高低温Chuck
- ☑ 20~4000X光学显微放大
- ☑ 功能丰富的测试软件
- ☑ 超高的测试精度和测试效率
- ☑ 便捷的仪器接入
- ☑ 半自动测试
- ☑ 可升级全自动测试
- ☑ 可升级射频测试

Model SHCV series

规格

型号		SHCV-6	SHCV-8	SHCV-12	
外形		860mm长*850mm宽*700mm高	880mm长*860mm宽*750mm高	1300mm长*920mm宽*920mm高	
重量		约180公斤	约250公斤	约380公斤	
电力需求		AC220V,50~60HZ			
Chuck	尺寸	6英寸	8英寸	12英寸	
	X-Y轴行程	6*6英寸	8*8英寸	12*12英寸	
	X-Y轴移动解析度	0.1um			
	X-Y轴重复定位精度	±1um			
	最高移动速度	≥ 50 mm/sec			
	Z轴行程	10mm			
	Z轴移动解析度	0.1um			
	Z轴重复定位精度	±1um			
	Theta角度行程	±10°	Theta角度解析度	0.0001°	
	样品固定方式	多孔真空吸附，独立分区控制			
切换样品功能	样品台快速拉出				
结构	同轴高压设计，镀金，电学独立悬空，可作为背电极使用				
针座平台	规格	O型平台， 最多可放置8个针座	O型平台， 最多可放置10个针座	O型平台， 最多可放置12个针座	
	行程&调节方式	平台可以快速升降，行程 6mm并带自动锁定功能			
温控特性	温度范围	- 100~200℃	- 80~200℃	- 60~200℃	
	温控精度	温度分辨率：0.01℃			
	加热电源	LVDC 低压直流			
	最低控温速率	±0.1℃ /小时			
	传感器	Pt100			
	制冷方式	液氮制冷或者压缩机制冷			
软件功能		wafer map的编辑 仪器的接入 数据的采集和图像化显示 数据的分析 差异数据的标定Ink mark 自定义Bin分 自动测试 通讯接口：RS232/484 TCP/IP, GPIB等	光学特性	显微镜行程	2*2inch
				移动精度	1um
				放大倍数	20-4000X
			点针规格	CCD像素	50W（模拟）/200W（数字）/500W（数字）
				点针精度	10微米/2微米/0.7微米
大功率规格	配置	大功率kelvin样品台 大功率夹具线缆 mult-pin 分流探针 大功率保护模块（针座用） 保护红外光幕，防止人员误进入工作区，触发时interlock互锁 大功率仪器连接模块	减震	12mm-12mm-12mm	
				10pA/100fA	
				接口形式	
			可选附件	主动式减震系统，50X物镜下画面不抖动	
				射频测试	chuck快速拉出装置
	卡盘镀金	PCB板夹具			
	激光修复	液晶热点侦测套装			
	最大测试电压	探针卡夹具	光强/波长测试接口部件		
		屏蔽箱	高低温样品台(-80~200℃)		
		加热台	显微镜倾仰装置		
	最大测试电流	500A（脉冲）	应用方向	晶圆测试，功率器件半自动测试	

Model SA series

量产型半自动/全自动探针台



- ☑ 超高的测试精度和超快测试速度
- ☑ 支持单点测试和连续测试
- ☑ 便捷的仪器接入
- ☑ 自动alignment/找晶圆中心/测量die size
- ☑ 功能丰富的测试软件
- ☑ 可升级自动wafer厚度测量和ID读卡

Model SA series

规格

型号	SA-6/SA-8/SA-12		外形	1500 (长) *1700 (宽) *1100(高)
重量	1700kg		电力需求/功率	220VAC±10V/50Hz/2.2KW
规格参数	能够测试的晶圆直径	6", 8", 12"		
	晶圆厚度	300≤T≤1000um（标准） 300≥T(薄片机型)		
	晶圆厚度偏差	±50um		
	Inlex time	300ms(标准速度， die尺寸 10mm, 包括Z上下0.3mm移动的时间)		
	Chuck 具备5轴移动机构	(X/Y/Z/theta/F)		
	X-Y轴行程	380mm, 最高速度300mm/s, 分辨率0.1um		
	XY全行程机械定位精度	± 2um (环境温度在±1℃以内波动时)		
	XY最大速度	300mm/s		
	chuck平面度	≤5 um		
	Z轴行程	37mm, 探针分离高度0.3mm,速度 30毫秒/0.3mm		
	Z轴移动解析度	0.1um		
	Z轴定位精度	±2um		
	Theta轴行程/解析度	±5°/0.0001°		
	光栅尺	0.1um光栅尺		
	预对位平台	光学原理检测，平边或者notch±1°定位精度		
	晶圆机械手	陶瓷机械手，cassette *1		
	晶圆装载单元	一个升降单元，预对位单元，晶圆传输单元以及他们的接口		
	自动对位系统	自动水平扫描、自动第一测试点定位、自动测试中心定位		
	自动上下片系统	料盒安全保护、晶圆定位边预对准		
	精确对位单元	pattern matching		
	位移传感器	采用静电电容传感器，分辨率 2um(option)		
	照明	同轴卤素灯照明或LED光源		
	视场	低倍情况：4.9*3.6mm 中倍情况：1*0.72mm 高倍情况：0.49*0.36mm		
	PC配置	I5CPU, 4G内存，128G固态硬盘等		
	LCD 显示器	对位显示为黑白，其他显示为彩色，中文		
	键盘	单元大小 15*15mm, 46 字母数字		
	报警器(三色灯)	红，黄，绿		
操作场地要求	2200mmX2200mm			
操作界面	Windows中文操作界面，中文MAPING动态显示			
标记	上下标记，标记可以实时或者离线标记，标记耗时15~300ms，采用ink或者Laser			
可以采用的cassette形式	FOUP 12/8/6"(13或者25片)；light FOUP 12/8/6"(13或者25片)，12/8/6" open cassette			
可选附件	自动磨针台	可以兼容高频测试头		晶圆ID 识别功能
	可以匹配自动晶圆盒取放设备（AGV or OHT）		直接和晶圆传输控制电脑或者服务器通讯	
	*FOUP(front open unified Pod)有别于普通open cassette，带有洁净气体单元（mini environment），可以在晶圆传输过程保持洁净在Class100洁净室里面，探针台内部可以达到Class 1"主体包括：控制盒，TTL，RS232，GBIP测试机接口			

Model FlexScan series

激光面板亮点修复机



- ✓ 稳定的修复结果
- ✓ 超快的激光
- ✓ 0.1um精度的直线电机平台
- ✓ 极小的损伤
- ✓ 1um的激光精度
- ✓ 可实现局部暗化
- ✓ 可以编辑任意修复形状
- ✓ 自动AOI定位
- ✓ 可做多工位设计
- ✓ 自动上下片

Model FlexScan series

规格

规格		Flex - 85
外形		3000mm宽*2500mm长*2500mm高
重量		约7500公斤
电力需求		380V, 50Hz, 3Phase, approx. 50A Max
修复能力	可修复样品尺寸	3~85寸
	可修复范围	显示区内任何位置
	修复时间	120S左右每个像素（尺寸200um*100um的pixel）
	适用产品类型	Cell段产品（OLED面板, IPS,ON-CELL/IN-CELL等TFT面板），模组段产品（已贴偏光片，带TP模组）
	遮光性	修补颜色在模组背光下不可见
平台功能	Gantry结构	龙门式
	X-Y-Z 行程	2000*1200*50mm
	移动精度	0.1um
	X-Y运动速度	0~200mm/s
	Z 运动速度	0~2mm/s可调
	定位	AOI坐标自动定位
光学特性	光路系统倍率	50X~ 1000X ,5X ,10X ,20X ,50X ,100X Objects
	物镜切换速度	0.2~0.7s
	聚焦	激光自动聚焦
	光学分辨率	0.7um
	相机	200W/500W像素工业相机
激光特性	激光系统	激光切割系统（5~500 nj/Pluse Maximum@250KHz,20X object ,532nm）
	能量调节精度	0-1000 steps 0-100%
	激光波长	1064nm, 532nm, 355nm
	脉宽	< 500fs
	光斑尺度	0.8~1.5um @100X object
		1.0 ~3.0 um @50X object
	激光寿命	> 10年，维护间隔 > 20,000 小时
	扫描面能量均匀性	优于 5% IR
	工作模式	Scan扫描式
	扫描形状	可任意定义形状
	工艺参数	软件可以添加任意组工艺参数
控制	工作模式	自动修复，实现数据的自动导入和输出，联机通讯 手动或者半自动修复
	上下片	机械手或者流水线
	CIM系统	有
	减震	主动式减震系统，能够实现50X 物镜下画面不抖动
	工业PC	23寸显示器&电脑：i7 处理器，1TB硬盘2块(其中一块为备份硬盘)，8G内存，1G独立显卡，DVD-ROM
	通讯接口	RS232/EtherCAT/GPIB等
	安全	整机带屏蔽罩，操作人员在屏蔽罩外操作
		紧急开关EMO
		限位sensor，运动平台和激光系统限位互锁
		Interlock报警，自动关闭系统(软件设置为可选)
应用方向	TFT-LCD Panel亮点的修复，OLED Panel亮点的修复	

Model TEG series

面板激光TEG Prober



- ✓ 稳定的测试结果
- ✓ 超快的测试速度
- ✓ 0.1um精度的直线电机平台
- ✓ 极小的损伤
- ✓ 1um的激光精度
- ✓ 超高的测试精度
- ✓ mult-probe card设计
- ✓ 自动AOI定位
- ✓ 自动上下片
- ✓ 自动测试

Model TEG series

规格

型号	LCD-70-TEG	LCD-100-TEG
外形	2500mm长*2000mm宽*2500mm高	3800mm长*2500mm宽*2500mm高
重量	约9700公斤	约14200公斤
电力需求	380V, 50Hz, 3Phase, approx. 50A Max	
可测试液晶屏尺寸	长宽≤1600 * 1100 mm(W x D), 厚度≤3mm	长宽≤2400 * 1400 mm(W x D), 厚度≤3mm
平台功能	Gantry结构	龙门式
	X-Y-Z轴运动行程	1600 * 1100 * 58mm
	X-Y运动速度	0~400mm/s可调
	X-Y精度 (最小移动量)	0.1um
	X-Y重复定位精度	±5um
	X-Y轴驱动	直线电机+光栅尺
	Z运动速度	0~2mm/s可调
	Z精度	0.25um
	Z重复定位精度	±1um
	Z轴驱动	伺服电机+光栅尺
光学特性	Z轴保护	电机保护+机械限位保护
	样品台平整度	±25um平整度 (检测方法: 显微镜等焦面测试法)
	样品台涂层	防静电涂层
	样品台高低温	Temp Chuck 或者 Thermal Stream (-55~200°C)
	光路系统倍率	5X, 10X, 20X, 50X Objects 放大倍率范围50X~500X
	聚焦	自动聚焦
	CCD	200/500万像素工业相机
	光源	面背光、点背光、上光源 光源亮度独立可调, 面背光可选择分区控制
	激光系统	激光切割系统 (2.2mj/Pulse Maximum@50Hz) 0-100%
	激光波长	1064nm, 532nm, 355nm
激光特性	光斑尺度	0.8~1.5um @100X object 1.0~3.0um @50X object
	工作模式	One Shot/Burst/Continue
	形状	可调节的矩形
	工作模式	自动测试, 实现数据的自动导入和输出 联机通讯, 手动或者半自动测试
	上下片	机械手或者流水线
	CIM系统	有
	减震	主动式减震系统, 能够实现50X 物镜下画面不抖动
	工业PC	23寸显示器&电脑: i7 处理器, 1TB硬盘2块 (其中一块为备份硬盘), 8G内存, 1G独立显卡
	通讯接口	RS232/EtherCAT/GPIB等
	安全	整机带屏蔽罩, 操作人员在屏蔽罩外操作 紧急开关EMO 限位sensor, 运动平台和探针系统限位互锁 Interlock报警, 自动关闭系统(软件设置为可选)
控制	应用方向	OLED/ TFT-LCD Panel TEG 测试和线路分析
	探针规格	针卡
		两套, 可同时测试两个patten Pitch范围: 定制 探针材质: 钨or铍铜等 工作模式: 可以单独测试, 或者两个针卡一起 测试。两个针卡间的相互距离可调。
		探针和TEG 对位方式
		坐标定位 测试过程中的二次视觉自动校准
		探针和TEG 的接触方式
		自动接触 探针自动保护功能机械限位, 可以根据panel 厚度设定限位高度, 也可以按探针接触样品 测试Pad时发生的形变, 设备通过探针形变 情况, 从而确定压入量。
		探针轴旋转行程
		360°
		探针旋转精度
		0.01°
	测试能力	旋转重复定位精度
		0.03°
		探针清洁
		自动清洁 清洁后视觉自动判断
		探针台漏电精度 (安装针卡的情况)
		100fA 以内 (测试标准: 给针卡任意针脚加压 -5V~+5V, 在不吹N2的情况下, 空载测试漏 电流<100fA) 吹氮气N2辅助干燥(Recipe 可以设置是否开启 且测试报告体现开N2与不开N2区别)
		测试系统
		两套 半导体参数测试系统 2*HRSMU+4*MPSMU+ CV 测试单元等
		TFT测试项目
		Ion Ioff Vth Mobility Swing
		Resistance 测试项目
		Rs Rc
		最大输送电压
		+-200V
		最大输送电流
		+-1A
		电流测试分辨率
		1fA (无需前置放大器)
		电压测试分辨率
		0.5uV
		CV 测试频率范围
		1kHz~5MHz
		接地单元电流值能力
		4.2A GNDU

Model LCD series

激光修复机



- ✓ 稳定的修复结果
- ✓ 超快的修复速度
- ✓ 高精度控制平台
- ✓ 便捷的操控软件
- ✓ 极小的损伤
- ✓ 面板生产工艺缺陷/不良修复
- ✓ 亮点/亮线/暗线/十字线等故障修复
- ✓ 可选择 激光去除特定材料而不损伤下层
- ✓ 最小可加工精度1*1um
- ✓ 可升级用于120英寸以内样品测试

Model LCD series

规格

型号		LCD-70	LCD-55	LCD-20
规格	尺寸	2000mm长* 1500mm宽* 2000mm高	1500mm长* 1300mm宽* 1500mm高	1200mm长* 800mm宽* 1500mm高
	重量	约2500公斤	约1200公斤	约120公斤
	电力需求	220V,50~60Hz		
样品台	大小	1600mm*1000mm	650mm*550mm	500mm*320mm
	样品台X-Y行程	样品台固定	样品台固定	样品台X-Y行程8*8英寸
	样品固定方式	自然放置	自然放置	自然放置
显微镜特性	光源	面背光、点背光、上光源	面背光、点背光、上光源	面背光、上光源
	行程	1600mm*1000mm*50mm	650mm*550mm*50mm	镜体固定,Z轴行程50mm
	CCD像素	50W(模拟)/200W(数字)/500W(数字)		
	目镜	10X目镜	10X目镜	10X目镜
	物镜	配置物镜： 5X,10X,20X,50X、100X (选配)	配置物镜： 5X,10X,20X,50X、100X (选配)	配置物镜： 5X,10X,20X,50X (选配)、100X (选配)
	物镜转盘	电动鼻轮	手动/电动鼻轮	手动鼻轮
	调焦	聚焦模式:电动	聚焦模式：手动或电动	聚焦模式：手动
	波长	波长可选择1064/532/355/266nm波段		
	能量	输出功率2.2mJ/pulse		
激光特性	微加工能力	可加工材质：Cr/Al/ITO/Ni/TFT/RGB/Poly Silicon/Mo/SiN/CF内杂质等		
	加工精度	最小可加工精度1*1um (配置100X镜头时)		
	冷却方式	可选择风冷激光或水冷激光		
控制系统	结构	精密数控系统，采用高精度运动控制卡和日本进口伺服驱动系统和步进系统实现3轴联合运动，实现X-Y平台的任意曲线的运动		高精度研磨级丝杠传动，精度1微米
	速度	速度分4档可调，可以设定最慢速度，最低速度下最小移动分辨率为1μm，最高速度不低于10cm/s		手动调制
	软件功能	软件系统能够实现激光控制，光源控制，物镜转盘切换，电动聚焦，平台控制，图像调整等功能。可实现图像点击移动，自定义轨迹，坐标储存，存储坐标定位手，动坐标定位，移动鼠标寻迹等功能。速度可以通过软件设定鼠标，移动的距离控制。	PLC，摇杆和电机控制	手动控制
防震		独立气浮防震平台		
可选附件	手动控制盒			
	维修专用补偿镜头	维修专用补偿镜头	维修专用补偿镜头	维修专用补偿镜头
	特殊定制	特殊定制	特殊定制	特殊定制
应用方向	70寸以内面板生产工艺不良和缺陷的修复，亮点、亮线、显示异常等故障修复	55寸以内面板生产工艺不良和缺陷的修复，亮点、亮线、显示异常等故障修复	20寸以内面板生产工艺不良和缺陷的修复，亮点、亮线、显示异常等故障修复 (Oled /LCD，手机，数码)	

Model LCVD series

LCVD激光修复机



- ✓ 稳定的修复结果
- ✓ 超高的修复精度
- ✓ 0.1um精度的直线电机平台
- ✓ 极小的损伤
- ✓ 1um的激光精度
- ✓ 功能丰富的软件
- ✓ 可以编辑修复形状
- ✓ 自动AOI定位
- ✓ 可做多工位设计
- ✓ 自动上下片

Model LCVD series

规格

型号	LCVD-G6	LCVD-G8.5
外形	2850mm (宽) X2500mm (长) X2500mm (高)	4000mm宽*3500mm长*2500mm高
重量	约7500公斤	约10500公斤
电力需求	380V, 50Hz, 3Phase, approx. 40A Max	380V, 50Hz, 3Phase, approx. 60A Max
可修复产品尺寸	长宽≤ 1500*1850 mm (W x D), 厚度≤3mm	长宽≤2500 * 2200 mm(W x D), 厚度≤3mm
沉积材质	W,Cr,Mo,Al	激光系统
沉积线路速度	5~10um/s(厚度5000 Å)	DPSS激光切割系统
单处缺陷修复时长	定位后, 修复单处缺陷时间在5s左右	Cw激光沉积系统
工艺参数	软件可以添加任意组工艺参数	能量调节精度
Cutting宽度	1um到50um可调	0-1000 steps
沉积宽度	2um到30um可调	0-100%
沉积边缘精度	+0.5um	Slit 窗口调节
沉积厚度	2000 Å ~15000 Å 可调	0~2.4mm
沉积线路的电阻值	<65欧姆 (宽度5um, 长度50um, 厚度5000 Å)	Slit 窗口调节精度
沉积稳定性	清洗/清洗次数>10 times 棉签蘸丙酮擦拭>500次 强酸碱测试>1H 毛刷擦拭>1H 超声波1MHZ>1H	1um
Gantry结构	龙门式	激光能量校准方式
X-Y-Z运动行程	LVCD-G6: 1500*1850*58mm(X-Y-Z) LVCD-G8.5: 2500*2200*58mm(X-Y-Z)	自动校准
X-Y运动速度	0~400mm/s可调	校准时间
精度(最小移动量)	0.1um	3mins
Z 运动速度	0~2mm/s可调	激光能量校准精度
精度(最小移动量)	0.1um	优于2%
重复定位精度	+/-5um	激光波长
修复对位精度	0.1um	Cut Laser :IR 1064nm, GRN 532nm, UV 266nm CVD CW laser :NUV 351nm
光路系统倍率	50X~ 1000X 5X, 10X, 20X, 50X NIR, 50X UV, 50X NUV Objects	脉宽
光学分辨率	0.7um	< 12 ns
物镜切换速度	0.2~0.7s	光斑尺度
切换镜头偏差	小于3um	2.0~ @50X object 1064nm (在标准mask上测试)
聚焦	激光自动聚焦	扫描面能量均匀性
相机	200万像素	优于5% IR
照明	平台有下光源, 并且能够上下光源切换, 屏蔽罩内安装照明, 照度达到1000lux以上	激光寿命
应用方向	TFT-LCD 和 OLED Array Panel 线路开路和短路的修复, Mask 的缺陷修复	Cut Laser: 10亿次激发 CVD CW laser: 8000小时
		修复工作模式
		Scan扫描式和 Step模式
		扫描路径
		可任意定义路径
		工作模式
		自动修复, 实现数据的自动导入和输出, 联机通讯 手动或者半自动修复
		上下片
		机械手或者流水线
		CIM系统
		有
		减震
		主动式减震系统, 能够实现50X 物镜下 画面不抖动
		工业PC
		23寸显示器&电脑: i7 处理器, 1TB硬盘 2块(其中一块为备份硬盘), 8G内存, 1G 独立显卡, DVD-ROM
		通讯接口
		RS232/EtherCAT/GPIB等
		安全
		整机带屏蔽罩, 操作人员在屏蔽罩外操作 紧急开关EMO 限位sensor, 运动平台和激光系统限位互锁 Interlock报警, 自动关闭系统 (软件设置为可选)

Model HALL series



- ✓ Keithley测试平台
- ✓ 超高精度的源表
- ✓ 模块化的设计
- ✓ 功能丰富的软件
- ✓ 可视化的界面
- ✓ 高低温变温环境

Model HALL series

规格

简介	本系统是集成Keithley 2400/2600系列高精度源表和Semishare Polaris 高低温平台采用范德堡法则设计的应用于高精度的测量半导体材料的载流子类型（P型/N型），载流子浓度，迁移率，电阻率，霍尔系数等参数。能够适用于Si, SiGe, SiC, GaAs, InGaAs, InP, GaN等各种材料。	
软件操作环境	Windows 98 / ME / 2000 / NT / Xp环境下	
	有效电流输出范围	6nA~100mA
	有效电压测量范围	-5~5V
	载流子浓度 concentration(/cm ³)	10 ⁷ - 10 ²¹
	迁移率Mobility(cm ² /Vs)	1~10 ⁷
	电阻率Resistivity (Ohm.cm)	10 ⁻⁴ - 10 ⁴
	A/B ratio	Ok
	RHD(cm ³ /C)	Ok
	RHC(cm ³ /C)	Ok
	RH(cm ³ /C)	Ok
	Sheet Resistance(Ohm)	Ok
	温度	温度(K):常温和77K 两个温度点
		Option:77K~500K ,0.1摄氏度精度，可通过程序设定
仪器尺寸和重量	主机尺寸	89mm 高 × 213mm 宽 × 370mm 长
	重量	3.21公斤
工作环境要求	0°~50°C, 70%R.H.	
存储环境要求	-25°C to 65°C	
范德堡法则终端转换器	200×120×110 mm (W×H×D)	
净重	7.7千克	
测量材料	Si, SiGe, SiC, ZnO, GaAs, InGaAs, InP, GaN, ITO等所有半导体薄膜(P型和N型)；	